

Московский государственный технический
университет имени Н.Э.Баумана

Факультет "Радиоэлектроника и лазерная техника"
Кафедра "Технологии приборостроения"



ВКР
на тему

Оптимизация процесса термического
окисления кремниевых подложек

Студент:
Руководитель:

Власов Е.Ю.
Шашурин В.Д.

Группа:

РЛ6-82

Москва
2018

Содержание

1 Введение 2

1 Введение

Объектом исследования данной работы являются

Предметом исследования данной работы являются

Цель работы

- Получение равномерного слоя оксида кремния на поверхности подложки в результате термического окисления при различных температурах

Задачи работы